

Facultatea **TPP**
 Specializarea **ICACRP**
 Anul **I**
 Semestrul **II**
 (Master / Licenta) **Master**

			Anul I
			31309
L u n i	M5	15:20 - 17:00	Simularea in regim dinamic a proceselor chimice, c, Popescu M., B III 3
			Simularea in regim dinamic a proceselor chimice, l, Popescu M., B III 3
	M6	17:10 - 18:50	Simularea in regim dinamic a proceselor chimice, c, Popescu M., B III 3
			Simularea in regim dinamic a proceselor chimice, l, Popescu M., B III 3
	M7	19:00 - 20:40	Simularea in regim dinamic a proceselor chimice, c, Popescu M., B III 3
			Simularea in regim dinamic a proceselor chimice, l, Popescu M., B III 3
M a r t i	M5	15:20 - 17:00	Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, c, Cursaru D., Ip6
			Optimizarea proceselor chimice, c, Cursaru D., Ip6
	M6	17:10 - 18:50	Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, c, Cursaru D., Ip6
			Optimizarea proceselor chimice, c, Cursaru D., Ip6
	M7	19:00 - 20:40	Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, c, Cursaru D., Ip6
			Optimizarea proceselor chimice, c, Cursaru D., Ip6
M i e r c u r i	M5	15:20 - 17:00	
	M6	17:10 - 18:50	Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, l, Ibrahim Ramadan, Ip1
			Optimizarea proceselor chimice, l, Cursaru D., Ip1
	M7	19:00 - 20:40	Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, l, Ibrahim Ramadan, Ip1
			Optimizarea proceselor chimice, l, Cursaru D., Ip1
J o i	M5	15:20 - 17:00	
	M6	17:10 - 18:50	Proiectarea conceptuala a proceselor chimice, l, Fendu E., FA4
	M7	19:00 - 20:40	Proiectarea conceptuala a proceselor chimice, l, Fendu E., FA4
V i n e r i	M5	15:20 - 17:00	Proiectarea conceptuala a proceselor chimice, c, Fendu E., EV4
	M6	17:10 - 18:50	
	M7	19:00 - 20:40	Proiectarea conceptuala a proceselor chimice, p, Fendu E., EV4

S
d
S
d
S
d
S
d
S
d
S
d
S
d
S
d
S
d
S
d
S
d